

1. Record Nr.	UNINA9910698316803321
Autore	Atwater H. A
Titolo	Si passivation and chemical vapor deposition of silicon nitride [[electronic resource]] : final technical report, March 18, 2007 // H.A. Atwater
Pubbl/distr/stampa	Golden, Colo. : , : National Renewable Energy Laboratory, , [2007]
Descrizione fisica	iv, 33 pages : digital, PDF file
Collana	NREL/SR ; ; 520-42325
Soggetti	Photovoltaic cells - Research Polycrystalline semiconductors - Research Silicon Thin films
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Title from title screen (viewed Mar. 20, 2008). "November 2007."